

# 艾尔艾斯特克诺洛吉·因福维奥斯溅射设备产品目录

我们可提供价格合理的HQ溅射系统。



株式会社 エイエルエステクノロジー

合作



DISPLAY & PLASMA TECHNOLOGY

**INFOVION**

INFOVION Inc.

INFOVION's  
COMBI-IBD

INFOVION's Combinatorial Ion Beam Sputter System can dramatically alter the existing paradigm for discovering new materials.



离子束溅射装置组合式  
规格

本公司除现有复合溅射设备外，现正着力强化溅射专用设备业务，与总部位于韩国首尔的Infovion公司建立合作关系，将其卓越的溅射设备引入日本市场进行销售。

## 关于 Infovion

### (1) Infovion公司简介

英福比昂公司作为韩国真空设备制造商，业务范围广泛涵盖面向大学研究的小型设备至大型在线设备及集群设备。

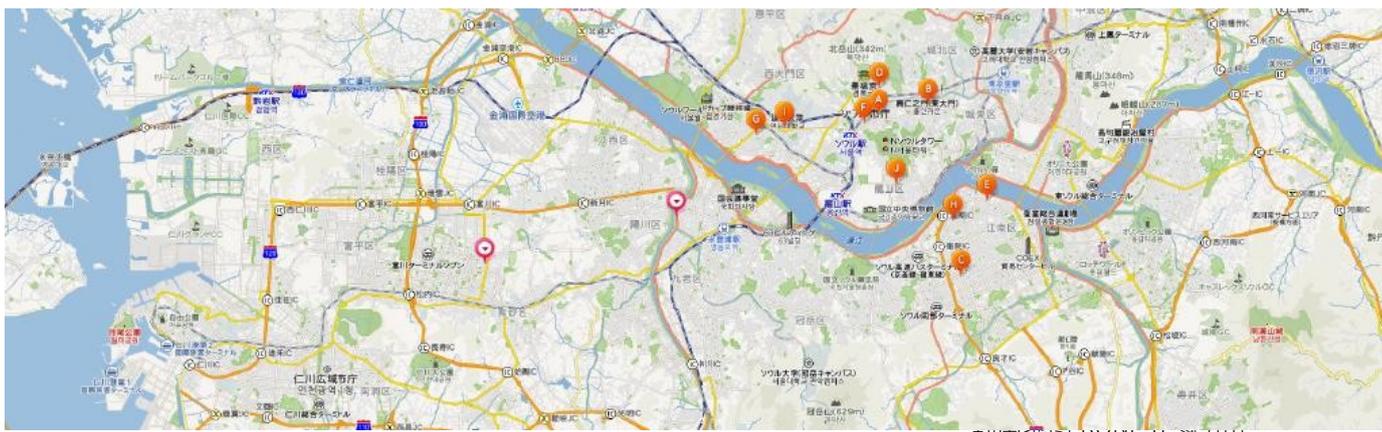
- 产品示例 离子枪、EB辅助枪、大型转盘式批量溅射设备、在线镀膜设备、集群镀膜设备、ALD设备等，业务覆盖广泛领域。
- 核心优势 具备处理离子与电子的高端核心技术实力。

### (2) 公司地址

地址：韩国首尔永登浦区五街5-3号（邮编150-095）

<http://www.infovion.com>

公司位于韩国首尔市中心区域，距离政治经济核心区汝矣岛（国会大厦所在地）仅5公里。（距金浦国际机场车程30分钟内，距首尔站最近地铁站30分钟内）



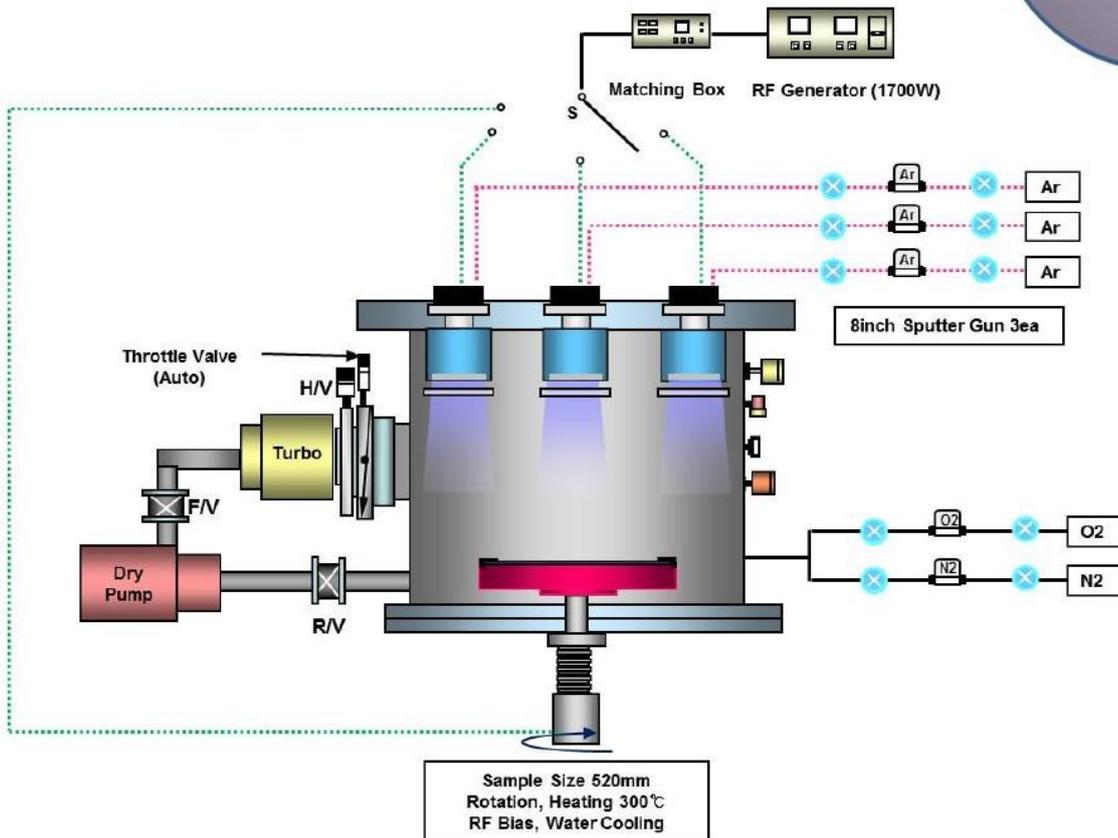
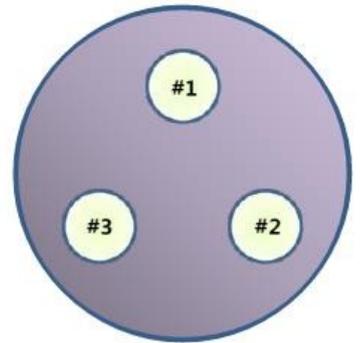
## 安装、调试、交付等

- 可在本公司工厂（日本）进行客户见证检验。  
原则上请在Infovion公司工厂（首尔）进行见证。
- 本公司技术人员（日本人）将出差进行设备安装调试及交接工作。

## 保修与售后服务

- (1) 质量保证 一年免费保修期
- (2) 保修期结束后，我司（日本）技术人员将继续负责维修等事宜。

<b>型号</b>	<b>S-ISM-1830</b>
分类	平行平板型溅射装置 (Φ8英寸阴极× 3台)
用途	小规模生产用・研究用

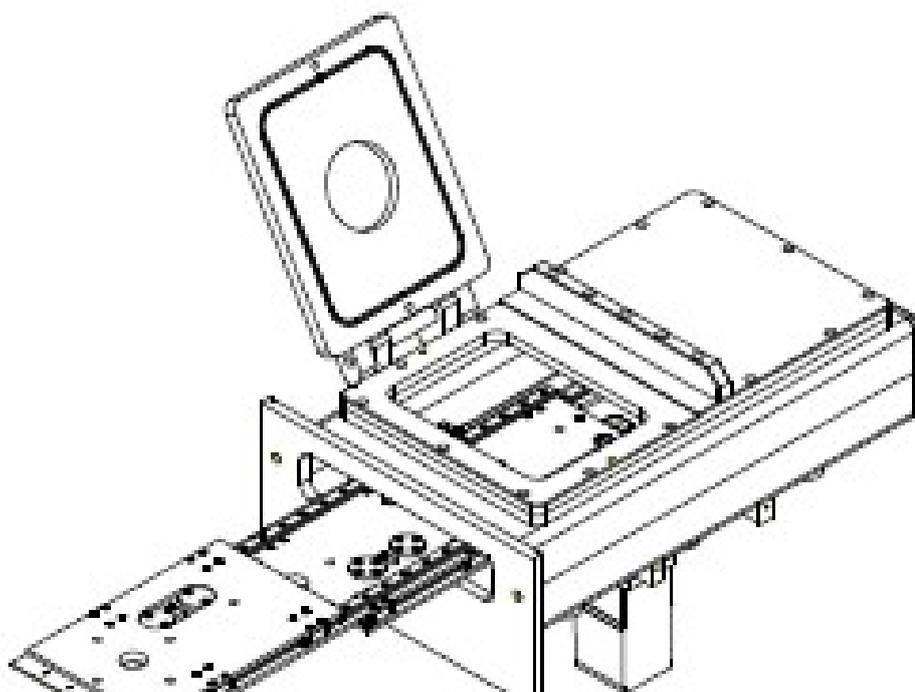


## 主要规格

	主要构成	规格
溅射室	多阴极	8英寸平面磁控管阴极 × 3台
	溅射电源	RF,13.56MHz,1700W × ×1台、 阴极切换器
	匹配	自动匹配 × 1台
	快门	独立快门 × 3套
	基板支架	支架直径 $\Phi 520\text{mm}$
		水冷、基板加热 (300°C、PID控制)
		基板转速5 rpm磁性流体密封
	反向溅射	可选配置
	成膜性能	$\Phi 400\text{mm}$ 范围内 $\pm 10\%$
排气系统	主排气泵	涡轮分子泵 2.400L/sec(N <sub>2</sub> )
	粗抽泵	干式泵
	溅射压力调节	节流阀/带自动压力调节机构
	真空性能	10 <sup>-7</sup> 托级
气体导入	气体种类	Ar (100 sccm) (O <sub>2</sub> 、N <sub>2</sub> 等)
	控制阀	质量流量控制器
控制关联	大型屏幕显示器	键盘输入
	制膜操作	配方全自动控制
	排气操作	自动

## 选项

- 负载锁定系统
- 溅射电源 (RF/DC)
- 工艺气体种类、流量
- 其他需求可根据客户要求提供定制服务。



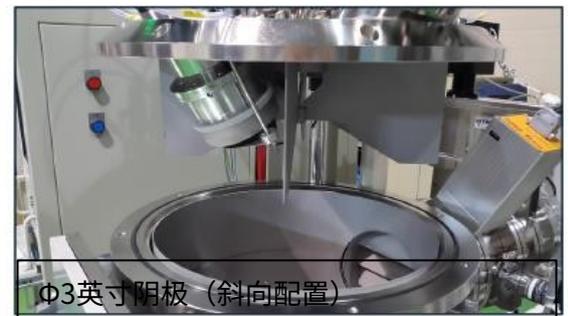
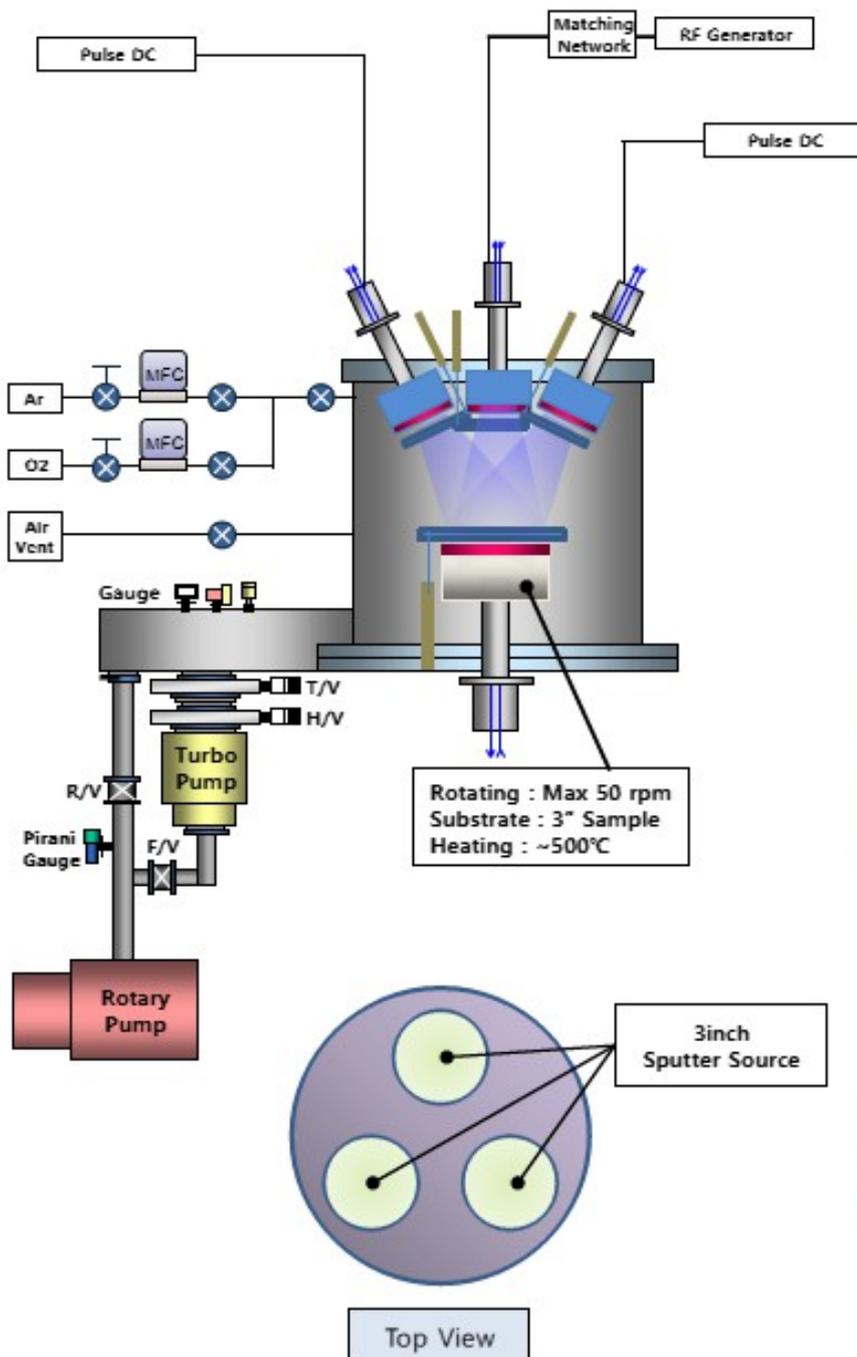
装载锁定系统

<b>型号</b>	<b>S-IS-1330</b>
分类	溅射装置 (Φ3英寸阴极×3台, 聚焦配置)
用途	研究用途 (半导体、新材料开发、传感器开发等)

特点可根据配方实现自动成膜。

支持三阴极同步放电

可制备多层膜、混合膜 (成分可控) 紧凑型设计



# 主要规格

	主要结构	规格
溅射室	多阴极	3英寸平面磁控管阴极 × 3台 (聚焦配置)
	溅射电源	射频电源, 13.56MHz, 600W×1台, 脉冲直流电源×2台
	匹配	自动匹配 x 1台
	快门	独立快门 (阴极快门3台、基板快门1台)
	基板支架	样品托架 直径 Φ3英寸
		水冷、基板加热 (500°C, PID 控制)
		基板旋转50 rpm磁性流体密封
	反向溅射	可选配置
成膜性能	Φ3英寸±10%	
排气系统	主排气泵	涡轮分子泵 1,100L/sec(N2)
	粗抽泵	旋转泵
	溅射压力调节	节流阀/带自动压力调节机构
	真空性能	10 <sup>-7</sup> 托级
气体引入	气体种类	Ar : 50 sccm / O <sub>2</sub> : 20 sccm
	控制阀	质量流量控制器
控制关联	大型屏幕显示器	键盘输入
	制膜操作	配方全自动控制
	排气操作	自动



# 其他设备示例

(上述目录设备仅为部分示例。详情请垂询。)

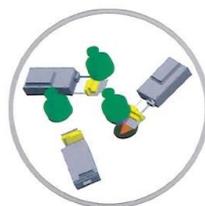
## INFOVION's Multi Layer E-beam Evaporator System

INFOVION's E-beam Evaporator System is Highly Reliable for Wide Range of Production and Research Applications



## INFOVION's Ion Beam Sputter Deposition System

INFOVION's IBSD System has Unique Characteristics, Including Process Optimization & Versatility that is Suitable for Difficult Applications



## INFOVION's COMBI-Sputter

INFOVION's Combinatorial Sputter System can dramatically accelerate the discovery of ideal compound and optimization process.

